文章编号: 0253-2239(2010)s100405

# 受激辐射耗尽荧光显微镜的激发耗尽过程与 空间分辨率计算

于建强1,2 袁景和2\* 方晓红2 李英骏1

<sup>1</sup>中国矿业大学(北京)理学院,北京 100083 (<sup>2</sup>中国科学院化学研究所分子纳米结构与纳米技术实验室,北京 100190)

摘要 通过四阶 Runge-Kutta 算法求解荧光介质的速率方程,详细分析了受激辐射耗尽(STED)显微镜的激发过 程和耗尽过程中的荧光态分子数密度转移过程,得到了高斯时间脉冲激发光将基态荧光分子抽运到荧光态所用的 时间与激发光强度的关系,得到了高斯时间脉冲耗尽光将荧光态分子经过受激辐射跃迁到基态所用时间与 STED 光强的关系,模拟了一个激发周期内的激发和耗尽过程,得到了 STED 显微镜激发光和耗尽光之间的最佳延迟时 间,此模拟结果对实验装置参数设置有指导作用。

**关键词** 显微;STED显微镜;空间分辨率;荧光分子激发和耗尽;同步延迟时间 **中图分类号** O436 **文献标识码** A **doi:** 10.3788/AOS201030.s100405

## Effects of Excitation and Depletion Process on Resolution of Stimulated Emission depletion Microscope

Yu Jianqiang<sup>1,2</sup> Yuan Jinghe<sup>2</sup> Fang Xiaohong<sup>2</sup> Li Yingjun<sup>1</sup>

<sup>1</sup> School of Science, China University of Mining and Technology (Beijing), Beijing 100083, China)
<sup>2</sup> Key Laboratory of Molecular Nanostructure and Nanotechnology, Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

**Abstract** The rate equations of fluorophore are solved with Runge-Kutta algorithm, and the process of the excitation and the depletion in stimulated emission depletion (STED) microscope is analyzed in detail. Gaussian shaped pulse is used to simulate ther excitation and the depletion process. The pump time versus the exciting time and intensity, the depletion time versus the intensity of depletion beam are calculated. With the simulation in an exciting and depletion period, the best synchronization delay time between the excited beam and the STED beam in STED microscope is achieved. These results will play an important role in the microscope setup. **Key words** microscopy; STED microscope; resolution; exciting and depletion; synchronization delay

**OCIS codes** 180.4315; 030.0030

### 1 引 言

Stefan Hell<sup>[1]</sup>在1994年提出了受激辐射耗尽 (STED)显微术理论,突破传统荧光光学显微镜成 像的衍射极限,可以极大地提高远场光学显微镜空 间分辨率,有望实现活细胞单分子超分辨三维成像,因此成为现阶段超分辨研究的重要发展方向。

普通光学显微镜的横向空间分辨率大约为  $\Delta r \approx \lambda/(2NA)$ ,其中 $\lambda$ 为激发光波长,NA为显微物

**基金项目:**国家 973 计划(2007CB815105)、国家自然科学基金(10874242)、中国科学院科研装备研制项目(YZ200925)资助课题。

导师简介:李英骏(1961—),男,教授,主要从事 X 射线激光及光物理方面的研究。E-mail:lyj@aphy.iphy.ac.cn

收稿日期: 2010-03-19; 收到修改稿日期: 2010-05-19

作者简介:于建强(1983—),男,硕士研究生,主要从事光物理等方面的研究。E-mail:jqyu@iccas.ac.cn

<sup>\*</sup> 通信联系人。E-mail:jhyuan@iccas.ac.cn

镜的数值孔径。对于活细胞成像,激发光波长  $\lambda$  通 常为可见光(约 500 nm),数值孔径  $NA \approx 1$ ,因此一 般光学显微镜的横向分辨极限大致在250 nm左右。 通过引入 STED 概念,将激发光焦斑周围的荧光态 分子退激发,可以实现纳米级空间分辨率,其分辨率 可以近似表达为  $\Delta r \approx \lambda/(2NA \sqrt{1+I_{STED}/I_s})^{[2,3]}$ , 其中  $I_{STED}$ , $I_s$ 分别代表 STED 光的强度和有机染料 半淬灭强度。理论上,只要 STED 光足够强,则空 间分辨率可以无限制地提高,但是考虑到荧光分子 漂白等现象,STED 光强总要低于一定的极限值。 德国的马普研究所 Hell 研究组已经利用 STED 技 术获得了  $\lambda/25$  的横向分辨率和  $\lambda/23$  的轴向分辨 率<sup>[4]</sup>。

本文使用四阶 Runge-Kutta 算法求解了荧光介 质的速率方程,分析了 STED 显微镜的激发过程和 耗尽过程中的荧光分子数密度转移过程,模拟了一 个激发周期内的激发和损耗过程;根据菲涅耳衍射 积分公式导出了入射准直高斯光束在焦点附近的光 场分布,得到了激发光和 STED 光聚焦后的光强在 横向和轴向的分布以及其产生的空间分辨率,得到 了最高空间分辨率对应的最佳 STED 光强度以及 同步延迟时间,为 STED 光学显微镜的设计提供了 依据。

#### 2 理论基础

典型的荧光分子能级结构如图 1 所示,其中 S<sub>0</sub>,S<sub>1</sub>分别表示荧光分子的基态和激发态,L<sub>0</sub>,L<sub>3</sub>分 别表示基态 S<sub>0</sub>的最低振动态和某个较高振动态, L<sub>2</sub>,L<sub>1</sub>分别表示激发态 S<sub>1</sub>的最低振动态和某个较 高振动态。激发光将荧光分子从S<sub>0</sub>激发到S<sub>1</sub>,经 过振动弛豫,荧光分子跃迁到 S1 的最低振动能级 L<sub>2</sub>,当荧光分子从该振动能级跃迁到基态 S<sub>0</sub>时,能 量通常会以荧光的形式辐射出去,被称为自发荧光 辐射过程。处于激发态的荧光分子在外界辐射影响 下,会产生与外界辐射同频率、同相位和同偏振的辐 射,这就是受激荧光辐射过程。这种受激荧光辐射 与自发荧光辐射竞争,导致荧光态分子关闭(非自发 荧光辐射状态),称为受激辐射耗尽(STED),该外 界辐射称为受激辐射耗尽光。为了避免二次激发, 通常将 STED 光波长设置为荧光分子发射谱的红 端。利用 STED 过程实现高空间分辨光学成像,需 要将物镜聚焦后的 STED 光斑构造为面包圈形状, 并且围绕在激发光焦斑周围,使得激发光焦斑中心 区域的荧光分子仍然处于荧光态(可以自发辐射荧 光), 而被 STED 光束照射的区域, 因发生受激辐射 耗尽过程而关闭(非荧光辐射状态)。从荧光分子的 能级结构可知,当荧光分子处于能级 L₂ 时为荧光 态,其荧光分子数密度直接影响自发辐射荧光的强 度,该数密度可以通过求解速率方程获得。



图 1 荧光分子能级图 Fig. 1 Energy levels of a typical fluorophore 荧光分子数密度遵循下列速率方程<sup>[5]</sup>:

$$\begin{cases} \frac{dn_{0}}{dt} = \frac{I_{\text{EXC}}\sigma_{01}}{h\nu_{\text{EXC}}} (n_{1} - n_{0}) + \frac{1}{\tau_{\text{VIBR}}} n_{3} \\ \frac{dn_{1}}{dt} = \frac{I_{\text{EXC}}\sigma_{01}}{h\nu_{\text{EXC}}} (n_{0} - n_{1}) - \frac{1}{\tau_{\text{VIBR}}} n_{1} \\ \frac{dn_{2}}{dt} = \frac{I_{\text{STED}}\sigma_{23}}{h\nu_{\text{STED}}} (n_{3} - n_{2}) + \frac{1}{\tau_{\text{VIBR}}} n_{1} - \left(\frac{1}{\tau_{\text{FLUOR}}} + Q\right) n_{2} \end{cases},$$
(1)  
$$\frac{dn_{3}}{dt} = \frac{I_{\text{STED}}\sigma_{23}}{h\nu_{\text{STED}}} (n_{2} - n_{3}) - \frac{1}{\tau_{\text{VIBR}}} n_{3} + \left(\frac{1}{\tau_{\text{FLUOR}}} + Q\right) n_{2}$$

式中 n<sub>0</sub> 表示基态能级 L<sub>0</sub> 的荧光分子数密度;n<sub>1</sub> 表 示第一激发态的高振动态能级 L<sub>1</sub> 上的荧光分子数 密度;n<sub>2</sub> 表示第一激发态的最低振动态能级 L<sub>2</sub> 上 的荧光分子数密度;n<sub>3</sub> 表示基态的高振动态能级 L<sub>3</sub> 上的荧光分子数密度,STED激发的受激辐射和自 发荧光辐射跃迁都会导致 n<sub>3</sub>的增加; I<sub>EXC</sub>, I<sub>STED</sub>分 别为激发光和 STED光的强度,λ<sub>EXC</sub>,λ<sub>STED</sub>分别为激 发光和 STED光的波长;σ<sub>01</sub>,σ<sub>23</sub>分别为相应能级跃 迁的分子吸收截面; *τ*VIBR, *τ*FLUO分别为振动驰豫寿命 和荧光寿命; Q为荧光淬灭速率, *h*为普朗克常量。 在通常温度条件下和孤立系统中, 初始条件和归一 化条件可以近似为

$$\begin{cases} n_0 \mid_{t=0} = 1 \\ n_i \mid_{t=0} = 0, i = 1, 2, 3 \end{cases}$$
 (2)

和

$$\sum_{i=0}^{3} n_i = 1, \qquad (3)$$

该速率方程包含了光与荧光物质相互作用的各个基 本过程,包括受激吸收、振动驰豫、自发荧光、荧光猝 灭、受激辐射等。

## 3 STED 荧光显微术激发和耗尽过程 模拟

采用四阶 Runge-Kutta 算法<sup>[6]</sup>求解上述速率方 程,对荧光分子的激发和受激耗尽过程进行了模拟。 其中高斯型激发光和 STED 光束脉冲宽度均设为  $\tau_{\text{EXC}} = \tau_{\text{STED}} = 300 \text{ ps},激发光和 STED 光波长分别为$  $<math>\lambda_{\text{EXC}} = 540 \text{ nm}$ 和  $\lambda_{\text{STED}} = 650 \text{ nm}, 荧光平均寿命$  $\tau_{\text{FLUO}} = 2 \text{ ns},振动弛豫平均寿命 <math>\tau_{\text{VIBR}} = 0.1 \text{ ps}, 荧光$ 淬灭速率  $Q = 10^8 \text{ s}^{-1}$ ,吸收截面  $\sigma_{01} = \sigma_{23} = 10^{-16} \text{ cm}^2$ , 算法积分步长为 1 ps。

#### 3.1 激发过程

荧光分子处于能级 L<sub>2</sub> 时为荧光态,为此模拟了 在不同激发光峰值强度下的荧光态分子数密度随时 间的变化关系(图 2),其中曲线 a,b,c 和 d 分别对 应于  $I_{EXC} = 3$  MW/cm<sup>2</sup>,30 MW/cm<sup>2</sup>,300 MW/cm<sup>2</sup> 和 3 GW/cm<sup>2</sup>,曲线 e 为激发光脉冲形状。





从图 2 可以看出,激发光脉冲峰值强度越大,荧 光态分子数密度增加越快,曲线 a 对应于 I<sub>EXC</sub> = 3 MW/cm<sup>2</sup>,荧光态分子数密度在激发光脉冲有效 激发时间内小于 0.2,此时荧光自发辐射强度较低, 不能产生充分的荧光态激发,当然也较少产生荧光 漂白;曲线 b 对应于 I<sub>EXC</sub> = 30 MW/cm<sup>2</sup>,此时荧光 分子数密度可达 0.8,已经实现有效的荧光态激发, 有较强的荧光自发辐射,同时也不会对介质产生明 显的荧光漂白;随着激发光强度的增加(曲线 c 和 d),在光脉冲峰值强度到来之前(t<0.5 ns),焦斑 内荧光分子已经几乎全部激发,此为饱和激发,极易 产生光漂白现象。所以对于设定的荧光染料分子, 激发光强在 3~30 MW/cm<sup>2</sup> 量级是适当的,此时可 以保证有较强的荧光辐射,同时又能够避免明显的 光漂白。

#### 3.2 受激辐射耗尽过程

为了研究 STED 光脉冲强度对荧光态分子耗尽过 程的影响,模拟了不同 STED 峰值强度下荧光态分子 数密度  $n_2$  的变化情况如图 3 所示,其中曲线 a,b,c,d,e和 f 分别对应于  $I_{\text{STED}} = 0,10$  MW/cm<sup>2</sup>,30 MW/cm<sup>2</sup>, 100 MW/cm<sup>2</sup>,1 GW/cm<sup>2</sup> 和 10 GW/cm<sup>2</sup>。其中曲线 a显示了自发荧光辐射过程中荧光态分子数密度  $n_2$  变 化情况。





从图 3 可以看出,随着 STED 光脉冲峰值强度 的增加耗尽速度加快,曲线 a 对应于自发荧光辐射 过程,此时粒子数密度以指数形式缓慢衰减;曲线 b 对应于  $I_{\text{STED}} = 10 \text{ MW/cm}^2$  的情况,分子数密度在 STED 光脉冲基本结束后仍然有 30%左右处于荧 光态,还具有自发荧光辐射能力,将会造成一定的荧 光背景,因此不能提供理想的空间分辨率;当 $I_{\text{STED}} =$ 30 MW/cm<sup>2</sup> 时,在 STED 脉冲基本结束时分子数 密度已经降低到 10%以下(曲线 c),此时的光强基 本可以满足通过 STED 实现提高空间分辨率的需 要;随着 STED 光强的增加(曲线  $d \sim f$ ),荧光态分 子数密度所需耗尽时间减小,在不损害样品活性的 前提下,STED 峰值光强越大越有利于耗尽荧光态 分子,获得高的空间分辨率。

#### 3.3 单激发周期模拟

在实际的 STED 显微术中,需要同步的激发和 STED 两束光分别实现荧光分子的激发和退激发, 一个激发脉冲和一个 STED 脉冲组成一个激发周 期。为了获得最佳 STED 光强,模拟了不同 STED 光强下荧光态分子数密度 n<sub>2</sub> 的变化。

一个激发周期内荧光态分子数密度  $n_2$  随时间 变化关系如图 4 所示,其中激发光峰值强度均设定 为  $I_{EXC}$  = 30 MW/cm<sup>2</sup>,STED 光峰值强度分别设定 为: 0,3 MW/cm<sup>2</sup>,30 MW/cm<sup>2</sup>,300 MW/cm<sup>2</sup>, 3 GW/cm<sup>2</sup>,STED 光脉冲与激发光脉冲之间的同步 时间延迟为 100 ps。



图 4 单周期模拟 Fig. 4 Simulation of single cycle

图 4 中,曲线 a 表示自发荧光辐射过程,此时荧 光态分子数密度已达到 0.8 以上,荧光分子得到较 充分的激发,然后荧光态分子数密度经过自发辐射 荧光而减小;曲线 b,c 和 d 分别表示 STED 光峰值 强度为 3,30,300 MW/cm<sup>2</sup> 时的荧光态分子数密度 随时间的变化情况,在这些 STED 强度下,光脉冲 结束后仍然残留部分荧光态分子,可以自发辐射荧 光,形成荧光背景而影响空间分辨率的提高;当  $I_{\text{STED}} = 3 \text{ GW/cm}^2$ (曲线 e)时,则几乎能够完全耗尽 荧光态分子,所以对于我们设定的荧光染料分子及 仪器参数,STED 光强达到 1 GW/cm<sup>2</sup> 量级能量密 度是合适的。

#### 4 光斑计算

可以通过对 STED 光束的波前调制获得面包 圈形状的 STED 光斑,如图 5 所示。其中 P 表示渐 变  $2\pi$  位相板,显微物镜 L 的焦距为 f。为了描述方 便,建立如图所示物方坐标系 O-xyz(对应的柱坐标 为 $(r,\theta,z)$ 和像方坐标系 O'-x'y'z(对应的柱坐标为  $(r',\theta',z)$ ,其中 O 为物镜光心,O' 为物镜焦点,z 轴 为光轴。入射准直高斯光束经过渐变  $2\pi$  位相板 P 调制后,再经物镜衍射到像方空间,研究了物镜几何 光学焦点附近的激发光场和 STED 光场分布。



图 5 通过波前调制获得面包圈形焦斑 Fig. 5 Doughnut disk with wavefront modulation

准直高斯光束的复振幅表示为 E(x,y,z) =Aexp  $\left(-\frac{x^2+y^2}{\omega_0^2}\right)$ exp(-ikz)(其中 $\omega_0$  为高斯光束的束腰半径,k 为波数),渐变  $2\pi$  位相板振幅透射率函数为  $T(r,\theta,z) = t$ exp $(-i\theta)$ ,  $0 < \theta < 2\pi$ (其中 $t \approx 1$  为振幅透射率),显微物镜的相位延迟因子为exp $(-ik\frac{x^2+y^2}{2f}) = exp(-ik\frac{r^2}{2f})$ (其中f 为物镜的像方焦距),根据菲涅耳-基尔霍夫衍射积分公式可以得到衍射光场复振幅分布为

$$E(r',\theta',z) = \frac{A t \exp\left[\frac{\mathrm{i}k r'^2}{2(z+f)}\right] \exp(\mathrm{i}kz)}{\mathrm{i}\lambda(z+f)} \times \int_{0}^{a^2\pi} \exp\left[-\frac{r^2}{\omega_0^2} - \frac{\mathrm{i}k}{2f}r^2 + \frac{\mathrm{i}k}{2(z+f)}r^2 - \frac{\mathrm{i}k}{z+f}rr'\cos\left(\theta-\theta'\right) - \mathrm{i}\theta\right] r \mathrm{d}r\mathrm{d}\theta, \tag{4}$$

式中 a 为显微物镜口径的半径。进一步得到面包圈 光斑强度分布为  $I(r', \theta', z) = |E(r', \theta', z)|^2$ 。其实 在(4)式中去掉渐变2π相位板透射率函数即为激发 光衍射斑复振幅分布。

模拟时设  $\omega_0 = 2.5 \text{ mm}, f = 3 \text{ mm}, 人射激发光$ 

聚焦前的峰值强度为 0.5 W/cm<sup>2</sup>,入射 STED 光聚 焦前的峰值强度为 660  $W/cm^2$ ,得到焦点处(z=0) 焦斑的横向分布如图 6 所示。

1.0



图 6 焦斑光强横向和轴向分布

Fig. 6 Lateral and Axial distribution of Intensity in focal spot 其中图 6(a) 为激发光在焦平面的光强分布图

像,根据瑞利判据可知最小分辨尺寸约为400 nm; 图 6(b)为 STED 光在焦平面形成的光强分布,可以 看出中心(r=0)处为极小值。图 6(c)为激发光焦 点附近的光强轴向分布,轴向分辨尺寸大于1 μm, 远大于横向分辨尺寸,图 6(d)为 STED 光焦点附近 的光强轴向分布,在轴向为中空光束。

#### 分辨率及参数选择 5

设焦点附近不同径向位置处荧光态分子数密度 随时间变化关系为 n<sub>2</sub>(r,t),于是自发荧光辐射强 度为

$$I(r,t) = I_{max}(r,t)\eta(r,t)n_2(r,t),$$
 (5)  
式中  $\eta(r,t)$ 为自发荧光辐射在荧光态分子数密度演  
化中所占的比例,可表达为

$$\eta(r,t) = \frac{1/\tau_{\rm FLUO}}{I_{\rm STED}(r,t)\sigma_{23}/(h\nu_{\rm STED}) + (1/\tau_{\rm FLUO}) + Q}.$$
(6)

模拟时设入射激发光在聚焦前的峰值强度为 0.5 W/cm<sup>2</sup>,同步延迟时间为100 ps,入射 STED 光 在聚焦前的峰值强度为 660 W/cm<sup>2</sup>,则自发荧光辐 射强度随横向距离的函数关系如图 7 所示,为了能 够更清楚地看到激发光、STED 光、荧光强度的对

比,对纵坐标强度做了对数。其中曲线 a 和 b 分别 表示激发光和 STED 光在焦平面上的峰值强度分 布,曲线 c 为焦点处荧光发射峰值强度分布。可以 计算出自发荧光辐射区域的半峰全宽为 28 nm, 而 激发光的焦斑半峰全宽为368 nm,分辨率得到约13 倍的改善。

1



图 7 自发荧光辐射区域横向分布

Fig. 7 Lateral distribution of fluorescence intenstity

随着 STED 光强的增加,分辨率会得到更大的 提高。图 8 为不同 STED 强度下的空间分辨率,其 中激发光峰值光强为 3  $MW/cm^2$ , 曲线 a, b 和 c 分 别对应于  $I_{\text{STED}} = 6.4 \text{ GW/cm}^2$ , 0. 64 GW/cm<sup>2</sup> 和  $64 \text{ MW/cm}^2$  o

从图 8 中可以看出当 STED 强度为 6.4 GW/cm<sup>2</sup>, 焦斑半峰全宽为 20 nm(曲线 a); 而当 STED 强度为



图 8 不同 STED 光强下的空间分辨率 Fig. 8 Resolution under different STED intensities 0.64 GW/cm<sup>2</sup> 时,焦斑半峰全宽为 50 nm(曲线 b), 比曲线 a 有明显展宽;当 STED 强度为64 MW/cm<sup>2</sup> 时,焦斑半半峰全宽为 58 nm(曲线 c),分辨率更低。 当耗尽光峰值光强进一步减小时,将会出现较强的次 级大,严重影响空间分辨率的提高。要得到优于

50 nm的空间分辨率,对于文中的

荧光分子,STED光强度应不小于 0.64 GW/cm<sup>2</sup>。

在激发光和 STED 光强度分别为 3 MW/cm<sup>2</sup>, 6.4 GW/cm<sup>2</sup> 时,还模拟了同步延迟时间对空间分 辨率的影响,如图 9 所示,其中图 9(a)为同步延迟 时间  $\Delta t=0$  时的自发荧光辐射区域横向分布,其半 高宽为 24 nm;图 9(b)为  $\Delta t=50$  ps 时的自发荧光 辐射区域横向分布,其半高宽为 22 nm;图 9(c)为  $\Delta t=100$  ps 时的自发荧光辐射区域横向分布,其半 高宽为 20 nm。传统上认为,两束脉冲的同步延迟 时间应该小于分子振动弛豫时间(一般小于1 ps), 以有效耗尽荧光态分子<sup>[7]</sup>。但是由于 STED 脉冲 为高斯形,且强度很高,其脉冲前沿已经能够有效地 对荧光态分子进行耗尽,因此适当的同步延迟反而 会提高空间分辨率。

图 9(d)中曲线 I, II 和 III 分别对应于同步延迟时间  $\Delta t = 0.2, 0.5, 1$  ns 时的自发荧光辐射区域 横向分布,可以明显看到有一个较大的背景,这是因 为同步延迟时间过长以至于 STED 光还未来到时 就已经有自发荧光辐射产生,从而降低空间分辨率。 总结图 9,最佳同步时间延迟为  $\Delta t \approx 100$  ps。

![](_page_5_Figure_6.jpeg)

图 9 分辨尺寸与时间延迟的函数关系 Fig. 9 Function relations of resolution adn delav time

在激发光和 STED 光强度分别为 3 MW/cm<sup>2</sup>, 6.4 GW/cm<sup>2</sup> 时,通过计算得出当脉冲宽度大于 400 ps 时,有较强的自发荧光辐射背景,需要更高的 STED 光强与自发荧光辐射竞争。当脉冲宽度为 100 ps,时间延迟  $\Delta t$ =200 ps 时,得到的最小分辨尺 寸为 28 nm,大于脉冲宽度为 300 ps 时的最小分辨 尺寸 20 nm,这是因为太短的 STED 脉冲不能有效 地耗尽荧光态分子数。因此为了获得最佳的横向空间分辨率,最佳的脉冲宽度应该在 300 ps 左右,相应的最佳延迟时间在 100 ps 左右。

#### 6 结 论

太小的激发光强度不足以引起充分的荧光分子 激发,难以探测;太高的激发光强度则容易导致光漂 白或其他非线性过程,使荧光分子失去辐射能力。 通过模拟可知,对于所选定的荧光染料分子,激发光 强在 3~30 MW/cm<sup>2</sup> 量级是适当的。

随着 STED 光光强的增加,荧光态分子数密度 所需耗尽时间减小,在不损害样品活性的前提下, STED 光峰值光强越大越有利于耗尽荧光态分子, 获得高的空间分辨率。对于所选定的荧光染料分 子,激发光强在1 GW/cm<sup>2</sup> 量级是适当的。

传统上认为,两束脉冲的同步延迟时间应该小 于分子振动弛豫时间,以有效耗尽荧光态分子。但 是由于 STED 脉冲为高斯形,且强度很高,其脉冲 前沿已经能够有效地对荧光态分子进行耗尽,因此 适当的同步延迟反而会提高空间分辨率。对于选定 的荧光分子及设备参数,通过模拟可知,当激发和 STED 脉冲宽度为 300 ps 时,最佳同步时间延迟为 Δt≈100 ps。

通过模拟,得到了 STED 荧光光学显微镜最佳 激发光强、STED光强以及同步延迟时间等信息,为 STED 荧光光学显微镜的设计奠定了理论基础。

#### 参考文献

- 1 Stefan W. Hell, Jan Wichmann. Breaking the diffraction resolution limit by stimulated emission: stimulated-emissiondepletion fluorescence microscopy [J]. Optics Letters, 1994, 19(11): 780~782
- 2 V. Westphal, S. W. Hell. Nanoscale Resolution in the focal plane of an Optical Microscope [J]. *Phys. Rev. Lett.*, 2005, 94(14): 143903
- 3 B. Harke, J. Keller, C. K. Ullal *et al.*. Resolution scaling in STED microscopy[J]. Opt. Express, 2008, 16(6): 4154~4162
- 4 V. Westphal, L. Kastrup, S. W. Hell. Lateral resolution of 28nm (λ/25) in far field fluorescence microscopy [J]. Appl. Phys. B, 2003, 77(4): 377~380
- 5 Zhou Bingkun *et al.*. Laser Principle [M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2004: 9~14 周炳琨. 等编著. 激光原理(第五版) [M]. 北京: 国防工业出版
- 社, 2004: 9~14 6 Guan Zhi, Lu Jinfu. Numerical Methods[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2006: 286~293
- 关 治, 陆金甫. 数值方法[M]. 北京:清华大学出版社, 2006: 286~293
- 7 Martin Schrader, Franziska Meinecke, Karsten Bahlmann *et al.*. Monitoring the excited state of a fluorophore in a microscope by stimulated emission[J]. *Bioimaging*, 1995, 3(4): 147~153